

日本顕微鏡学会主催 第28回電子顕微鏡大学

開講の御案内

電子顕微鏡を使った材料解析の研究・業務に就かれて間もない初心者の方々、操作は覚えただけでも装置のことをもっと詳しく知りたいとお考えではありませんか？ 装置のことを十分理解されている中級者の方々、データの解釈で困ったことはありませんか？

「電子顕微鏡大学」は、一般の講演会やシンポジウムと異なり、これら初心者・中級者を対象とした、講義形式の材料系基礎セミナーです。皆さんの不安やお困りを解決すべく、顕微鏡学会が誇る講師陣が、「平易で役立つセミナー」となるよう情熱を注ぎ続けてまいりました。アンケートによる受講者の意見の迅速な反映、講義後の「Q&A集」送付などが好評を博し、お陰様で第28回目を迎えます。

電子顕微鏡に関連した不安や疑問をお持ちの貴方、ぜひ受講をご検討ください。学生会員向け受講料は格安となっています。この機会に、学会入会の上ふって受講下さい。

【日 時】 2018年7月3日(火)、4日(水)

【会 場】 東京大学本郷キャンパス 理学部1号館 小柴ホール

東京都文京区本郷 7-3-1

交通：地下鉄（東京メトロ丸ノ内線または都営大江戸線）本郷三丁目

地下鉄（東京メトロ南北線）東大前、（東京メトロ千代田線）根津 等

【定 員】 150名（定員に至った時点で締め切ります）



【受講料】

	日本顕微鏡学会会員 賛助会員（各団体5名まで） 連携学協会会員（次頁参照）	協賛学協会会員 （次頁参照）	非会員
一般	30,000円	45,000円	60,000円
学生	3,000円	10,000円	10,000円

受講申し込みと同時に、日本顕微鏡学会への入会手続きをいただいた場合、会員資格での受講となります。入会手続きは、<http://microscopy.or.jp/about/admission/> をご覧ください。

【申込方法】 日本顕微鏡学会ウェブページ（<http://microscopy.or.jp/univ/>）からお申し込みください。尚、申し込み開始は2018年4月20日(金)の予定です。

【申込締切】 2018年6月15日(金)。

この日を過ぎての申込み、あるいは開催当日会場での申込みはできませんのでご注意ください。

【振込方法】 ウェブページで申込みが完了しますと、登録したメールアドレスに「受講申し込み完了通知」が届きます。メールが届きましたら、**申込締切り日（6月15日）までに、メール記載の銀行口座に受講料をお振り込みください。**（恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。）
申込締切り日（6月15日）までに振り込みが行われない場合、申し込みが取り消されることがありますのでご注意ください。開催日の1~2週間ほど前に「講義テキスト」「受講証」「領収書」を送付します。「講義テキスト」「受講証」は当日会場で使用しますので大切に保管し、当日ご持参下さい。

【問合せ先】 申し込みに関するお問い合わせは 公益社団法人 日本顕微鏡学会 電子顕微鏡大学ヘルプデスク
FAX: 03-5227-8632 E-mail: jsm-denken@bunken.co.jp
講習の内容等に関するお問い合わせは 第28回電子顕微鏡大学実行委員長
物質・材料研究機構 三留 正則
FAX: 029-851-6280 E-mail: MITOME.Masanori@nims.go.jp

< 連 携 学 協 会 >

日本生物物理学会 日本解剖学会

< 協 賛 学 協 会 > (予定, 順不同)

日本物理学会 応用物理学会 日本分析化学会 日本金属学会 日本鉄鋼協会 電気学会 電子情報通信学会 軽金属学会
日本セラミックス協会 高分子学会 スマートプロセス学会 日本アイソトープ協会 表面技術協会 日本複合材料学会
日本表面科学会 日本結晶学会 日本航空宇宙工業会 日本塑性加工学会 電子情報技術産業協会 日本材料学会
日本材料科学会 精密工学会 ステンレス協会 溶接学会 日本鉱物科学会 日本アルミニウム協会 日本放射光学会

◇ 第 28 回電子顕微鏡大学プログラム (予定)

< 第 1 日目 > 2018 年 7 月 3 日 (火) 9 : 30 ~ 17 : 40

1. 透過電子顕微鏡のハードウェア

近藤 行人 (日本電子)

2. 電子回折法 —電子回折の原理と電子回折図形から得られる構造情報—

津田 健治 (東北大学)

3. 明視野・暗視野法 —回折コントラスト法—

荒河 一渡 (島根大学)

4. 高分解能電子顕微鏡法の基礎

今野 豊彦 (東北大学)

5. 走査型透過電子顕微鏡 (STEM)

阿部 英司 (東京大学)

< 第 2 日目 > 2018 年 7 月 4 日 (水) 9 : 00 ~ 17 : 10

6. 電子線ホログラフィー

原田 研 (理研)

7. 電子顕微鏡における EDS による組成分析 —EDS 測定の際の留意点—

原 徹 (物材機構)

8. 電子エネルギー損失分光法 (EELS) 入門 —計測・解析・解釈に役立つ基礎知識—

木本 浩司 (物材機構)

9. 走査電子顕微鏡の基本と応用 —多様な機能をどう使うか—

佐藤 馨 (JFE テクノリサーチ)

10. 電子後方散乱回折 —SEM の中で結晶学的情報を得る—

小暮 敏博 (東京大学)

11. 試料作製法

谷山 明 (新日鐵住金)